

クロスセクションポリッシャ



メーカー	日本電子株式会社
型式	IB-9020CP
概要	SEM観察や結晶方位解析に適したイオンビームによる断面試料作製装置です。
仕様	イオン加速電圧：2～6kV ミリングスピード：100 μ m/H以上 最大搭載試料サイズ：幅11mm×長さ10mm×厚さ2mm 使用ガス：Arガス
オプション	試料回転ホルダ、ハンディラップ
利用条件	試料の切り出し、表面研磨等の試料加工は事前に実施の上ご持参ください。 (表面研磨が不十分ですと、ご希望に沿った断面作製ができない可能性があります) SEM、FIB利用時は、装置利用料に含まれておりますが、単独利用の場合は下記の利用料金がかかります。
設置場所	地域産学連携研究センター 装置室A
利用料	2,640円/時間 (税込)
連絡先	予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。 044-934-7250 (内線7250) cii●mics.meiji.ac.jp (●の部分を@に置き換えてお送りください)